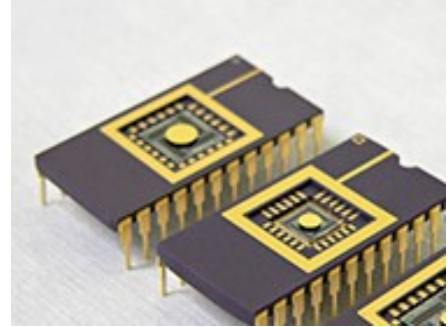


二维 MEMS 扫描镜 (MEMS Mirror)

微机电扫描镜，又称 MEMS 扫描镜，是通过电机驱动镜面倾斜，从而对光束实现偏转控制的器件。相比扫描振镜等常见的光束扫描器件，MEMS 扫描镜具有体积小、重量轻、功耗低、对环境影响不敏感等特点，而且 MEMS 扫描镜可与位置传感器集成使用，实现更高的定位精度。MEMS 扫描镜的应用主要包括：投影显示、条码扫描、生物成像、激光加工、激光雷达等领域。



这款无转向节二维 MEMS 扫描镜完全采用单晶硅材料制成。该二维 MEMS 扫描镜中不含有任何移动的金属、塑料和线圈等部件，也没有易于发生故障的压电或电磁促动器，所以该二维 MEMS 扫描镜具有很高的位置重复精度与可靠性。同时，这款二维 MEMS 扫描镜完全由免维护的纯弹性材料(单晶硅)构成，并完全采用静电驱动方式，因此工作过程中没有电流。这款无转向节二维 MEMS 扫描镜可实现**大角度、超快二维光束扫描**。二维扫描角度可达 32 度，并且功耗极低，仅 1mW。该二维 MEMS 扫描镜采用线性驱动方式和四象限可寻址静电梳驱动设计，保证了很好的电压与角度的线性度。

主要特点：

- 模拟电压控制可实现任意角度偏转；
- 点到点光束扫描，驱动电压与扫描角度一一对应；
- 模块设计方便选择各种不同尺寸的镜面，以根据不同应用实现优化；
- 同时在 XY 两个方向实现高速扫描
- 动态模式扫描，XY 两个方向大角度扫描(e. g. -160 to 160)

Aunion Tech Co.,Ltd

Room 2802, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center,
No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China

Tel: +86-21-51083793

E-Mail: info@auniontech.com

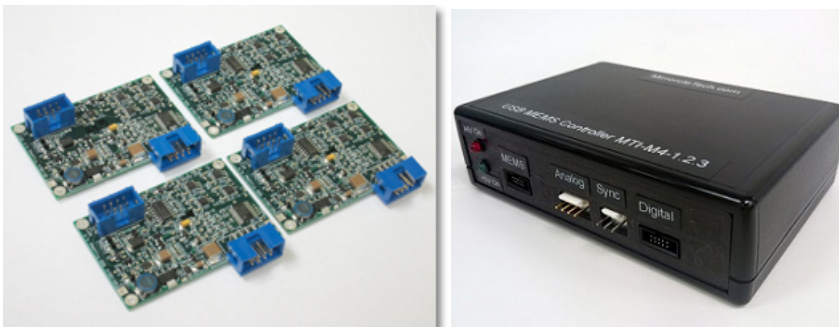
Fax: +86-21-34241962-8009

Website: www.auniontech.com

主要参数:

Integrated Mirror Devices	Bonded Mirror Devices
镜面大小: 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 20.mm and 2.4mm diameter always in stock	镜面大小: 2.0, 2.4, 3.0, 3.6, 4.2, and 5.0mm diameter in stock, larger possible in special orders.
点到点驱动模式最大倾斜角度: -6° to $+6^{\circ}$ mechanical each axis, varies with design type.	点到点驱动模式最大倾斜角度: -6° to $+6^{\circ}$ mechanical on each axis, varies with design type.
共振驱动模式最大倾斜角度: -7° to $+7^{\circ}$ mechanical	共振驱动模式最大倾斜角度: -7° to $+7^{\circ}$ mechanical, varies with design type.
<ul style="list-style-type: none"> • 表面粗糙度: <10 nm rms • 驱动方式: 静电驱动 • 镜面曲率半径: >5 m • 镜面镀膜: Aluminum or Gold • 位置重复精度: better than 0.0005° (500 micro-degrees) at room temperature • 工作温度: -40°C to 105°C • 光学窗口: Anti-reflection coated fused silica windows. • 光学损伤阈值: up to 2W any mirror, any wavelength. Above 2W depends on mirror size, coating, and wavelength. E.g. 3W CW blue or green on a 2mm or larger mirror . • 初始共振旋转频率: >3 kHz for both axes for small mirror sizes, >1.2kHz for 2.0mm size, etc. 	

MEMS 扫描镜驱动控制器:



Aunion Tech Co.,Ltd

Room 2802, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center,
No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China

Tel: +86-21-51083793

E-Mail: info@auniontech.com

Fax: +86-21-34241962-8009

Website: www.auniontech.com

MEMS 扫描镜整套系统开发包：



开发包标准配置：

- ◆ 3 个二维 MEMS 扫描镜
- ◆ 配套软件
- ◆ USB MEMS 控制器
- ◆ 安装支架
- ◆ 光学面包板
- ◆ 5mW 635nm 红光激光器

可根据客户要求，定制配置方案

Aunion Tech Co.,Ltd

Room 2802, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center,
No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China

Tel: +86-21-51083793

E-Mail: info@auniontech.com

Fax: +86-21-34241962-8009

Website: www.auniontech.com